



Beitrag ID: 7

Typ: nicht angegeben

## Cl-based etching of III-V materials for photonics applications (Oxford)

Donnerstag, 19. Oktober 2023 16:15 (30 Minuten)

### Title

**Vortragende(r):** Dr. FAHIM, Reast (Oxford Instruments)

**Sitzung Einordnung:** Afternoon Talks